การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอน และผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน

นางสาววิภากร จีวะสุวรรณ

สถาบนวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 ISBN 974-17-7149-5 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FABRICATION OF AMORPHOUS SILICON AND MULTICRYSTALLINE SILICON HETEROJUNCTION SOLAR CELLS

Miss Wipakorn Jevasuwan

สถาบนวิทยบริการ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2004 ISBN 974-17-7149-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอน
	และผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน
โดย	นางสาววิภากร จีวะสุวรรณ
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครื่องาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

		คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
	(ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)	
คณะกรรมการสอบ	เวิทยานิพนธ์	
		ประธานกรรมการ
	(ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)	
		อาจารย์ที่ปรึกษา
	(ศาสตราจารย ดร. ดุสต เครองาม)	
	(รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร)	กรรมการ
		กรรมการ
	(ดร. ภาวัน สยามชัย)	

วิภากร จีวะสุวรรณ : การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอน และผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน (FABRICATION OF AMORPHOUS SILICON AND MULTICRYTALLINE SILICON HETEROJUNTION SOLAR CELLS) อาจารย์ที่ ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครื่องาม, จำนวนหน้า 57 หน้า. ISBN 974-17-7149-5.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้รายงานผลการศึกษาการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของ ฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน เพื่อพัฒนาให้ได้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มี ต้นทุนการผลิตต่ำและมีประสิทธิภาพสูง แผ่นฐานชนิดผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอนชนิดพี (p-mc-Si) มีความหนาประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (a-Si:H) ปลูกด้วยวิธีการ แยกสลายก๊าซไซเลนด้วยวิธีพลาสมาซีวีดี โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบในวิทยานิพนธ์นี้มี 2 แบบ คือ 1) ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI และ ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI โดยที่ในเซลล์ แสงอาทิตย์โครงสร้างแบบที่ 1) ชั้น p-mc-Si ทำหน้าที่เป็นชั้นผลิตพาหะด้วยแสง และในเซลล์ แสงอาทิตย์โครงสร้างแบบที่ 2) ทั้งชั้น i-a-Si:H และ p-mc-Si ทำหน้าที่เป็นชั้นผลิตพาหะด้วยแสง

ในการศึกษาดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ เพื่อหาเงื่อนไขความเหมาะสมต่างๆ ที่ จะทำให้ได้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซไซ เลน ความหนาของฟิล์ม a-Si:H เงื่อนไขทางเคมีสำหรับการกัดแผ่นฐาน และเงื่อนไขกรรมวิธีการ ปลูกฟิล์มบาง ITO เป็นต้น

ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบที่ 1) ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด 6.52% และโครงสร้างแบบที่ 2) ITO/ n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI ได้ค่า ประสิทธิภาพสูงสุด 8.22% ผลการวัดสเปกตรัมตอบสนองต่อแสงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบที่ 2) มีความกว้างของสเปกตรัมมากกว่าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบที่ 1) ซึ่งแสดงให้ทราบว่าในเซลล์ แบบที่ 2 นั้น ทั้งฟิล์มบางชนิด i-a-Si:H และ ชั้น p-mc-Si ทำหน้าที่เป็นชั้นผลิตพาหะตามที่ ออกแบบไว้

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลย

ภาควิชา<u>วิศวกรรมไฟฟ้า</u> ลายมือชื่อนิสิต สาขาวิชา<u>วิศวกรรมไฟฟ้า</u> ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา <u>2547</u>..... # # 4670579221 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING KEY WORD: AMORPHOUS SILICON/MULTICRYSTALINE SILICON/SOLAR CELLS/ HETEROJUNCTION

WIPAKORN JEWASUWAN: FABRICATION OF AMORPHOUS SILICON AND MULTICRYTALLINE SILICON HETEROJUNTION SOLAR CELLS. THESIS ADVISOR: PROF. DUSIT KRUANGAM, D. Eng., 57 pp. ISBN 974-17-7149-5.

This thesis reports the study on fabrication of a-Si:H and mc-Si heterojunction solar cells. The purpose is to improve solar cells that have low production cost and higher efficiency. The thickness of the p-mc-Si substrates is 0.3 mm. The a-Si:H film was grown by glow discharge plasma CVD method. There are two fundamental structures in this thesis: 1) ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI and 2) ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI. In the first structure, the p-mc-Si layer plays a role as the carrier-generating layer with incident light. In the second structure, both of the i-a-Si:H and the p-mc-Si are carrier-generating layers.

Various fabrication parameters were varied find the optimal condition for the highest efficiency solar cells such as the SiH_4 discharging power, the a-Si:H thickness, the chemical condition for wafer etching and the condition for the growth of the ITO film.

The results show that the highest efficiencies of the ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI and the ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI structures are 6.52% and 8.22%, respectively. The spectral response of the second structure is wider than that of the other, which implies that both the i-a-Si:H film and the p-mc-Si layer in the second structure are carrier-generating layers.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ และ เครื่องมือต่างๆ จากห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศ. ดร. ดุสิต เครื่องาม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ กรุณาให้คำแนะนำต่างๆ ที่มีค่ายิ่งอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นการทำวิทยานิพนธ์จนกระทั่ง วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้แก่ ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว รศ. ดร. มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร ศ. ดร. ดุสิต เครืองาม และ ดร. ภาวัน สยามชัย ที่ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อวิจารณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้คำแนะนำซึ่งได้แก่ ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว รศ. ดร. มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร รศ. ดร. บรรยง โตประเสริฐพงศ์ รศ. ดร. ชุมพล อันตรเสน ศ. ดร. ดุสิต เครืองาม รศ. ดร. สมชัย รัตนธรรมพันธ์ ผศ. ดร. ทรงพล กาญจนซูชัย และ อ. ดร. ชนินทร์ ละลิ่ว

ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณบัณฑิตา รัฐวิเศษ คุณเกษร สุขทรัพย์ศรี คุณศุภโชค ไทยน้อย คุณพรชัย ช่างม่วง คุณพัฒนา พันธุวงศ์ คุณขวัญเรือน ไทยน้อย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความ ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและงานทางด้านธุรการต่างๆ

ขอขอบคุณคุณจักรพันธ์ จันทนา รุ่นพี่ปริญญาเอก คุณหัสเนตร์ โสดาบรรลุ คุณสุนทร ชาวหนองหิน และคุณณัฐพล ช่วงสุวนิช รุ่นพี่ปริญญาโทที่ให้คำแนะนำและความ ช่วยเหลือในงานวิจัยเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณกำลังใจและความช่วยเหลือจากเพื่อนๆน้องๆ นิสิตสังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำทุกท่าน

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลรอบข้างทุกท่านที่ให้ความ ห่วงใยและเป็นกำลังใจในการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี คุณประโยชน์อันจะเกิดจากผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บูรพาจารย์ ตลอดจนคุณบิดามารดาที่ได้มีส่วนช่วยวางรากฐานการศึกษาแก่ผู้วิจัย

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ঀ
กิตติกรรมประกาศ	ନ୍ଥ
สารบัญ	Ĩ
สารบัญตารางถ	Ĵ
สารบัญภาพ	ฏ
ด้าดริบายด้าย่ด	

บทที่

1. พื้นฐานและที่มาของวิทย <mark>านิพนธ์</mark>	1
1.1 บทนำ	1
1.2 พื้นฐานและที่มาของวิทยา <mark>นิพนธ์</mark>	1
1.2.1 คุณสมบัติของผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน	2
1.2.2 คุณสมบัติของอะมอร์ฟัสซิลิคอน	3
1.3 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์	5
1.4 ขอบเขตของวิท <mark>ยา</mark> นิพนธ์	5
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	5
2. โครงสร้างและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอน	
และผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน	6
2.1 ບກນຳ	6
2.2 โครงสร้างและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร	
แบบที่ 1 (ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/Al)	6
2.3 โครงสร้างและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร	
แบบที่ 2 (ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/Al)	9
2.4 สรป	9

บทที่

3. การประดิษฐ์และการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร	
ของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน	10
3.1 บทนำ	10
3.2 กระบวนการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอน	
และผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิค <mark>อน</mark>	10
3.2.1 การเตรียมแผ่นฐาน	_12
3.2.2 การเคลือบชั้น <mark>อะลูมิเนียม</mark>	_14
3.2.3 การปลูกฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน	15
3.2.3.1 โครงสร้างของระบบ Glow Discharge Plasma CVD	15
3.2.3.2 การเกิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน <u>.</u>	19
3.2.4 การปลูกฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงอินเดียมดีบุกออกไซด์	20
3.3 การวัดและการพัฒนาโปรแกรมการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์	25
3.4 การวัดสเปกตรัม <mark>ผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอ</mark> าทิตย์	_28
3.5 สรุป	29
4. ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิ <mark>ตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่</mark> 1 โครงสร้าง ITO/n-a-Si [·] H/n-mc-Si/Al	30
4 1 มหายัก	20
4.1 บทนา 4.2 ยุดการสึกษาดักษณะสบบัติเดาต์พูตของเซดด์แสงดาพิตย์ เบื่อทำการเปลี่ยบ	30
4.2 ผถา เภาบบ เกบบเนอสอายก๊าสของการปอกฟิล์บบาง n-a-Si·H	30
ท แกลงเพพารเลการแอกลลายการบองการอลู่แพลมอาทิตย์ เมื่อทำการเปลี่ยน	0
4.3 ผสกา กราการ กรายการแรงสมาคร กรายการแสงสแสง 5 การ เพษา กา กรายสนุม ต่าดการกรรมวงตรฐรัญฟิล์รารเวร กราย 1	24
л лама полинано и п-а-он п	4
4.4 이렇고	20
9	39
จ 5. ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2	<u>39</u>
 4 5. ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI 	39 40
 4 5. ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI	39 40 40
 4 5. ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI	39 40 40

ฃ หน้า

บทที่	^{เม} หน้า
5.3 สรุป	46
6. สรุป	47
รายการอ้างอิง	48
ภาคผนวก	49
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	57



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ชนิดและวัตถุประสงค์ในการใช้แผ่นฐานแบบต่างๆ	12
3.2 เงื่อนไขโดยสรุปสำหรับการปลูกฟิล์ม a-Si:H ในงานวิทยานิพนธ์นี้	19
3.3 เงื่อนไขในการปลูกฟิล์ม ITO	22



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 (ก) ตัวอย่างโครงสร้างของผลึก mc-Si	
(ข) แผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้	2
1.2 ตัวอย่างโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมซิลิคอนใน a-Si:H	3
1.3 โครงสร้างของวิทยานิพนธ์	4
2.1 โครงสร้างและลักษณะ <mark>แผนภูมิแถบ</mark> พลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อ	
เฮเทอโรแบบที่ 1 (ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI)	7
2.2 โครงสร้างและลักษณะแผนภูมิแถบพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อ	
เฮเทอโรแบบที่ 2 (ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/Al)	8
3.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของ a-Si:H และ mc-Si	11
3.2 การเตรียมแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si	12
3.3 การเตรียมแผ่นกระจ _ุ กใ <mark>ส</mark> Corning # 7059	13
3.4 แผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si ที่ทำการกัดผิวด้วยวิธี Mirror Etching ที่เวลาต่างๆ	13
3.5 (ก) ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง Metallic Evaporator	
(ข) เครื่อง Metallic Evaporator ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้	14
3.6 แผนผังของระบบ Glow Discharge Plasma CVD สำหรับปลูกฟิล์มบาง a-Si:H	17
3.7 ระบบ Glow Discharge Plasma CVD ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์	17
3.8 ครอบแก้วสุญญาก <mark>าศ</mark> สำหรับปลูกฟิล์มบาง a-Si:H	18
3.9 ลักษณะการติดตั้งถังก๊าซและก๊าซเรกูเลเตอร์	18
3.10 เม็ด pellet ของ ITO	20
3.11 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง Electron Beam Evaporator	21
3.12 เครื่อง Electron Beam Evaporator ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้	21
3.13 ลักษณะของฟิล์ม ITO ที่ปลูกได้ที่อุณหภูมิแผ่นฐานต่างๆกัน	22
3.14 เครื่อง UV Spectrophotometer สำหรับวัดสเปกตรัมสัมประสิทธิ์การทะลุผ่านแสง	23
3.15 ผลการวัดสเปกตรัมการทะลุผ่านแสงของฟิล์ม ITO	
ความหนา 2,000 Å พารามิเตอร์คือ อุณหภูมิแผ่นฐาน	24
3.16 ผลการวัดอิทธิพลของอุณหภูมิแผ่นฐานที่มีต่อความต้านทานของฟิล์ม ITO และ การ	
ทะลุผ่านของแสง (วัดที่ความยาวคลื่น 810 nm) โดยที่ฟิล์ม ITO หนา 1,500 Å	24

3.17 แผนภาพของระบบการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์	
ด้วยแสงอาทิตย์เทียมและคอมพิวเตอร <u>์</u>	25
3.18 วงจรสมมูลของการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์	26
3.19 เครื่องวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้	26
3.20 แผนผังการวัดสเปกตรัมผลตอบ <mark>สนองทางแสง</mark> ของเซลล์แสงอาทิตย์	28
3.21 ระบบการวัดสเปกตรัมผลต <mark>อบสนองต่อแสงของเ</mark> ซลล์แสงอาทิตย์	28
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรง <mark>ดันไฟฟ้าว</mark> งจรเปิดของเซลล์แสงอาทิตย์	
และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซ (RF Power)	31
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง <mark>กระแสไฟฟ้าลัด</mark> วงจรของเซลล์แสงอาทิตย์	
และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซ (RF Power)	31
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลล์แฟกเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์	
และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซ (RF Power)	32
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างป <mark>ระสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์</mark>	
และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซ (RF Power)	32
4.5 สเปกตรัมผลตอบสนองทางแส <mark>งของเซลล์แสงอาท</mark> ิตย์ที่กำลังไฟฟ้า	
ในการแยกสลายก๊าซเท่ากับ 6 W, 10 W, 15 W แล <mark>ะ</mark> 20 W ตามลำดับ	34
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของเซลล์แสงอาทิตย์	
และความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H	35
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิ <mark>ตย์</mark>	
และความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H	35
4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลล์แฟกเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์	
และความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H	36
4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์	
และความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H	36
4.10 สเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ความหนา	
ของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H เท่ากับ 100 Å, 250 Å, 500 Å และ 750 Å	38
4.11 ตัวอย่างผลการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง	
ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITOn-a-Si:H/p-mc-Si/Al ที่ความเข้มแสง AM1	38

5.1	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์และความหนา	
	ของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2,000 Å และ 3,000 Å	_41
5.2	ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์และความหนา	
	ของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2,000 Å และ 3,000 Å	_41
5.3	ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลล์แฟกเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์และความหนา	
	ของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2,000 Å และ 3,000 Å	42
5.4	ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์และความหนา	
	ของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2,000 Å และ 3,000 Å	42
5.5	สเปกตรัมผลตอบสน <mark>องทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ความหนาของ</mark>	
	ชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2000 Å และ 3,000 Å	_44
5.6	ตัวอย่างผลการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์ <mark>แสงอาทิต</mark> ย์โครงสร้าง	
	ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI ที่ความเข้มแสง AM1	_44
5.7	้เปรียบเทียบสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ	
	คือ โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI (กราฟเส้นสีดำ) และ	
	ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc <mark>-Si/Al (กราฟเส้นสีน้ำเงิน</mark>)	<u>45</u>

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายคำย่อ

Al	:	Aluminum
a-Si:H	:	Hydrogenated Amorphous Silicon
c-Si	:	Crystalline Silicon
DI Water	:	De-ionized Water
FF	:	Fill Factor (%)
ITO	:	Indium Tin Oxide
J _{max}	-:-	Maximum Current (mA/cm ²)
J _{sc}	:	Short Circuit Current (mA/cm ²)
mc-Si	:	Multicrystalline Silicon
P _{input}	:	Light Power Input (Watt)
Glow Discharge Plasma CVD	:	Glow Discharge Plasma Chemical Vapor Deposition
P _{max}	12	Maximum Power Output (Watt)
Si	3: 4	Silicon
V _{max}	:	Maximum Voltage (V)
V _{oc}	14.46	Open Circuit Voltage (V)

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

พื้นฐานและที่มาของวิทยานิพนธ์

1.1 บทนำ

เมื่อความต้องการใช้พลังงานในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แหล่งพลังงานบน โลกมีอยู่อย่างจำกัด จึงมีการนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ มาใช้มากขึ้นเพื่อช่วยแก้ไข ปัญหาทางด้านพลังงานในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่าง ยิ่ง เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด มีอยู่ทั่วไปและมีอยู่อย่างไม่จำกัด นอกจากนี้ การนำแสงอาทิตย์มาใช้โดยเซลล์แสงอาทิตย์นั้นก็ไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษใดๆ ขณะใช้งาน เช่น มลพิษทางอากาศ ฝนกรด และสภาวะเรือนกระจก จึงไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบ ต่อทั้งระบบนิเวศทางธรรมชาติและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ต่างจากแหล่งพลังงานจากฟอสซิลอัน ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามการจะทำ ให้เซลล์แสงอาทิตย์มีการใช้งานแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั้น เราก็จำเป็นต้องพัฒนาให้เซลล์ แสงอาทิตย์มีต้นทุนการผลิตลดลง และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

1.2 พื้นฐานและที่มาของวิทยานิพนธ์

จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นถึงข้อดีของการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ ใน งานวิทยานิพนธ์นี้จึงให้ความสนใจไปที่การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ และมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเลือกใช้สารกิ่งตัวนำซิลิคอนเป็นวัตถุดิบหลัก เพราะเป็นธาตุที่มีมากและ ราคาถูก มาทำการทดลองประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีฟิล์มบางอะมอร์-ฟัสซิลิคอน (Hydrogenated Amorphous Silicon ย่อว่า a-Si:H) ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี ผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน (Multicrystalline Silicon ย่อว่า mc-Si) เนื่องจากทั้ง a-Si:H และ mc-Si มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการเหมาะแก่การนำมาประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกัน โดย เคลือบฟิล์มบาง a-Si:H ด้วยวิธีการแยกสลายด้วยประจุเรืองแสงซึ่งเป็นวิธีพลาสมาซีวีดีวิธีการ หนึ่ง (Glow Discharge Plasma Chemical Vapor Deposition ย่อว่า Glow Discharge Plasma CVD) ที่มีต้นทุนถูกให้ทับลงบนแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si สร้างเป็นชั้นรอยต่อเฮเทอโร เนื่องจาก a-Si:H มีค่าของช่องว่างพลังงานอยู่ประมาณ 1.7-1.8 eV ในขณะที่ช่องว่างพลังงาน ของ mc-Si มีค่าเท่ากับ 1.1 eV เพื่อให้ชั้น a-Si:H ทำหน้าที่เป็นชั้นหน้าต่างกว้างรับแสงซักนำให้ แสงอาทิตย์ผ่านเข้าสู่ผลึก mc-Si ได้ดี และสร้างสนามไฟฟ้าภายในให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ ในขณะ ที่ชั้น mc-Si จะทำหน้าที่เป็นชั้นทำงาน นอกจากนี้ในงานวิทยานิพนธ์ได้ทำการทดลองเพิ่มชั้น ทำงานที่เป็นชั้น a-Si:H เข้าไปอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ ได้มากยิ่งขึ้น

1.2.1 คุณสมบัติของผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน

ผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน (mc-Si) คือผลึกที่มีระนาบของผลึก (Crystalline Plane) หลายชนิดปนกันอยู่ในระนาบเดียวกัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวอย่างโครงสร้างแสดง ดังรูปที่ 1.1 (ก) และรูปที่ 1.1 (ข) แสดงแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้ อาณาเขตของผลึกแต่ละระนาบนั้นเรียกว่า เกรน ซึ่งเกรนเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทาง ไฟฟ้าและทางแสง [1-2] เมื่อนำผลึก mc-Si มาประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนั้นเพื่อลด อิทธิพลดังกล่าว ผลึก mc-Si ที่นำมาใช้จึงต้องมีเกรนขนาดใหญ่กว่าความหนาของเซลล์ แสงอาทิตย์ เพื่อทำให้พาหะที่เกิดจากแสงสามารถเดินทางผ่านรอยต่อออกสู่ภายนอกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คุณสมบัติเด่นของผลึก mc-Si มีดังนี้คือ

- มลึก mc-Si มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon ย่อว่า c-Si) จึง เหมาะที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำ
- ผลึก mc-Si มีค่าช่องว่างพลังงานอยู่ระหว่าง 1.1 eV ซึ่งตอบสนองต่อแสงอาทิตย์ ในช่วงความยาวคลื่นยาวได้ดี
- 3) ผลึก mc-Si มีค่าเวลาอายุพาหะที่ยาวนานมากกว่า a-Si:H
- 4) ผลึก mc-Si มีค่าความคล่องตัวพาหะสูงกว่า a-Si:H
- 5) ผลึก mc-Si ให้ค่ากระแสไฟฟ้าเอาต์พุตสูงกว่า a-Si:H



รูปที่ 1.1 (ก) ตัวอย่างโครงสร้างของผลึก mc-Si

(ข) แผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้

1.2.2 คุณสมบัติของอะมอร์ฟัสซิลิคอน

ความไม่เป็นระเบียบของโครงสร้างเป็นข้อแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวนำชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (a-Si:H) และชนิดผลึก โดยที่ a-Si:H นั้นจะไม่มีการเรียงตัวของอะตอมที่แน่นอนและมีการ เรียงตัวของพันธะระหว่างอะตอมที่เป็นระเบียบในระยะสั้นคือ ช่วงระยะของอะตอมสองสาม อะตอม ดังแสดงในตัวอย่างโครงสร้างของ a-Si:H รูปที่ 1.2 ทำให้ a-Si:H มีคุณสมบัติที่แตกต่าง จากผลึก c-Si หลายด้านดังต่อไปนี้

- a-Si:H มีค่าช่องว่างพลังงานอยู่ระหว่าง 1.7–1.8 eV ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับ สเปกตรัมของแสงอาทิตย์
- a-Si:H มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงสูงกว่าผลึก c-Si ถึง 10 เท่า ทำให้ใช้วัตถุดิบ น้อย ซึ่งเป็นการประหยัดวัตถุดิบลงไปมาก
- 3) a-Si:H มีลักษณะเป็นฟิล์มบางและเป็นเนื้อเดียวกันตลอดจึงสามารถปลูกติดบนแผ่น ฐานได้หลายชนิด เช่น แผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si แผ่นแก้ว แผ่นกระจก เป็นต้น และ สามารถผลิตให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ง่าย
- a-Si:H สามารถผลิตเป็นฟิล์มบางหลายชั้นได้ง่ายเนื่องจากผลิตจากก๊าซที่อุณหภูมิต่ำ และง่ายในการต่อเชื่อมสิ่งประดิษฐ์เข้าด้วยกันบนแผ่นฐานเดียวกัน
- 5) a-Si:H ประดิษฐ์ด้วยกระบวนการ Glow Discharge Plasma CVD ที่ใช้อุณหภูมิเพียง 150-200 °C และสามารถเติมสารเจือปนโดยการเติมก๊าซเข้าไปพร้อมกันในขณะปลูก ได้ ทำให้สามารถลดพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้ในการประดิษฐ์ลง เมื่อเทียบกับการปลูก ผลึก c-Si ที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,400 °C และการแพร่ซึมสารเจือปนที่ต้องใช้ อุณหภูมิสูงถึง 800 - 1,200 °C



รูปที่ 1.2 ตัวอย่างโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมซิลิคอนใน a-Si:H

จากคุณสมบัติเด่นของผลึก mc-Si และ a-Si:H [3] ดังกล่าว ทำให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ ประดิษฐ์ขึ้นในงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการรวบรวมเอาคุณสมบัติที่ดีของทั้งสอง เข้าไว้ด้วยกัน รูปที่ 1.3 แสดงถึงโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้



รูปที่ 1.3 โครงสร้างของวิทยานิพนธ์

1.3 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์

- ศึกษาปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิกของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของ a-Si:H และผลึก mc-Si
- 2. ประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของ a-Si:H และผลึก mc-Si
- 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนการผลิตต่ำ

1.4 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์

- ศึกษาปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิกของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ITO/n-a-Si:H/ p-mc-Si/Al และรอยต่อ ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/Al
- ประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/Al และรอยต่อ ITO/ n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/Al
- 3. วัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้น
- 4. วัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้น
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1. ได้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีรอยต่อเฮเทอโรของ a-Si:H และผลึก mc-Si
- ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูง
- 3. ได้ต้นแบบโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถนำไปพัฒนาผลิตในเชิงพาณิชย์
- 4. ช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานให้กับประเทศโดยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย

โครงสร้างและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน

2.1 บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างและหลักการทำงานเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์ นี้ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างแรกคือโครงสร้างพื้นฐานรอยต่อพี-เอ็นของ n-a-Si:H และผลึก p-mc-Si โครงสร้างที่สองคือ โครงสร้างที่มีการแทรกชั้น i-a-Si:H เพิ่มเข้าไปตรงกลางในโครงสร้าง พื้นฐานระหว่างชั้นของ n-a-Si:H และผลึก p-mc-Si เพื่อเพิ่มบริเวณชั้นทำงานให้แก่เซลล์ แสงอาทิตย์ โดยที่โครงสร้างทั้งสองจะมีชั้นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงอินเดียมดีบุกออกไซด์ (Indium Tin Oxide ย่อว่า ITO) ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าในด้านรับแสงและชั้นอะลูมิเนียม (Aluminum ย่อว่า AI) ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์

2.2 โครงสร้างและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1

(ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/Al)

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นในงานวิทยานิพนธ์นี้จะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานคือ ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI ดังแสดงในรูปที่ 2.1 พร้อมด้วยลักษณะแผนภูมิ แถบพลังงาน ในการใช้งานแสงจะส่องเข้าทางด้านขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO เข้าสู่ชั้น n-a-Si:H และ แผ่นฐานซึ่งเป็นผลึก p-mc-Si ตามลำดับ เมื่อแสงเดินทางเข้าสู่เซลล์แสงอาทิตย์ แสงส่วนใหญ่จะ เดินทางทะลุชั้น n-a-Si:H เข้าไป เนื่องจากชั้น n-a-Si:H มีค่าของช่องว่างพลังงานกว้างกว่าชั้น p-mc-Si ดังนั้นชั้น n-a-Si:H จึงทำหน้าที่เสมือนชั้นหน้าต่างและสร้างแรงดันไฟฟ้าภายใน (Built-in Potential) ให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ และแสงจะถูกดูดกลืนโดยชั้น p-mc-Si ซึ่งทำหน้าที่เป็นชั้น ทำงาน ทำให้เกิดเป็นคู่ของอิเล็กตรอนและโฮลขึ้น จากนั้นอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะถูกสนามไฟฟ้า ภายในแยกให้ไหลออกสู่ภายนอกผ่านทางด้านชั้น n-a-Si:H และชั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO ส่วนโฮล จะไหลไปทางด้านชั้น p-mc-Si และชั้ว AI



รูปที่ 2.1 โครงสร้างและลักษณะแผนภูมิแถบพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์

รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 (ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย



รูปที่ 2.2 โครงสร้างและลักษณะแผนภูมิแถบพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 (ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI)

จุฬาลงกรณมหาวทยาลย

2.3 โครงสร้างและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 (ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/Al)

นอกจากโครงสร้างแบบที่ 1 แล้ว ในวิทยานิพนธ์นี้ได้ออกแบบและประดิษฐ์เซลล์ แสงอาทิตย์ที่มีการเพิ่มชั้น i-a-Si:H เข้าไป เป็นโครงสร้างขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO/n-a-Si:H/ i-a-Si:H/p-mc-Si/AI ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ซึ่งคาดว่าโครงสร้างนี้จะให้กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตและ แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากชั้น i-a-Si:H จะช่วยดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นสั้น ได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มบริเวณชั้นทำงานในเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์มีเพิ่มมากขึ้นด้วย เมื่อแสงเดินทางเข้าสู่เซลล์แสงอาทิตย์ แสงส่วนใหญ่จะเดินทางทะลุ ขั้น n-a-Si:H ซึ่งทำหน้าที่เป็นชั้นหน้าต่างและสร้างแรงดันไฟฟ้าภายใน แสงที่มีความยาวคลื่นสั้น จะถูกดูดกลืนโดยชั้น i-a-Si:H ทำให้เกิดคู่ของอิเล็กตรอนและโฮลในชั้น i-a-Si:H ขึ้น ส่วนแสงที่มี ความยาวคลื่นยาวจะเดินทางต่อเข้าไปในชั้น p-mc-Si และแสงที่มีความยาวคลื่นยาวดังกล่าวจะ ถูกดูดกลืนโดยชั้น p-mc-Si ทำให้เกิดคู่ของอิเล็กตรอนและโฮลขึ้นในชั้น p-mc-Si ต่อจากนั้น อิเล็กตรอนจะถูกสนามไฟฟ้าภายในแยกให้ไหลออกสู่ภายนอกผ่านทางด้านชั้น n-a-Si:H และ ชั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO ส่วนโฮลจะไหลไปทางด้านชั้น p-mc-Si และซั้น AI

2.4 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงโครงสร้างและหลักการทำงานพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อ เฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอนทั้งสิ้น 2 แบบด้วยกันคือ

1. โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อ ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI และ

2. โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อ ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI

โดยแสดงลักษณะแผนภูมิแถบพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละโครงสร้างประกอบ สำหรับโครงสร้างทั้งสองที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้ จะเห็นว่าเป็นโครงสร้างที่ไม่มีความซับซ้อนมาก นัก จึงมีความเหมาะสมสำหรับการนำไปประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำ และให้ ประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก

การประดิษฐ์และการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน

3.1 บทนำ

ในบทนี้ จะกล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนการประดิษฐ์และการวัดลักษณะสมบัติเอาต์-พุตของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอนซึ่ง ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมแผ่นฐาน การปลูกฟิล์มชั้นต่างๆ และการใช้แสงอาทิตย์เทียมในการวัด ลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งแต่ละชั้นก็จะใช้เครื่องมือแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ออกไป

นอกจากนี้จะอธิบายถึงการหาเงื่อนไขของการปลูกฟิล์มชั้นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO โดย อาศัยการศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มด้วยการเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น อุณหภูมิของแผ่น ฐาน และใช้การวัดค่าการทะลุผ่านของแสงของชั้นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO ด้วยเครื่อง UV Spectrophotometer, การวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของชั้นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO แบบง่ายด้วย Multimeter เพื่อหาเงื่อนไขของการปลูกที่ดีที่สุดในการนำมาใช้ประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์

สุดท้ายจะกล่าวถึงการวัดและการพัฒนาโปรแกรมการวัดคุณลักษณะสมบัติเอาต์พุตของ เซลล์แสงอาทิตย์ด้วยแสงอาทิตย์เทียม และการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์ แสงอาทิตย์ โดยในบทนี้จะได้อธิบายถึงรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ และหลักการทำงาน ของเครื่องมือที่ใช้ พร้อมทั้งแสดงภาพถ่ายของเครื่องมือที่ใช้จริงในงานวิทยานิพนธ์นี้ด้วย

3.2 กระบวนการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและ ผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน

การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของ a-Si:H และผลึก mc-Si มีขั้นตอนต่างๆ โดยสรุปแสดงดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของ a-Si:H และ mc-Si

3.2.1 การเตรียมแผ่นฐาน

แผ่นฐานที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้แสดงดังตารางที่ 3.1 พร้อมกับแสดงวัตถุประสงค์ของ การใช้แผ่นฐานแต่ละชนิด รูปที่ 3.2 แสดงภาพการเตรียมแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si และรูปที่ 3.3 แสดงการเตรียมแผ่นกระจกใส Corning # 7059 ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้

แผ่นฐาน	วัตถุประสงค์
แผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si	เพื่อประดิษฐ์และวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของ
ชนิด p ของบริษัท Wack <mark>e</mark> r	เซลล์แสงอาทิตย์
(10 cm x 10 cm x 450 μm)	
แผ่นกระจกใส # 7059	เพื่อวัดการทะลุผ่านของแสง, ความหนาของฟิล์ม,
ของบริษัท Corning	<mark>อัตรากา</mark> รปลูกฟิล์ม, ช่องว่างพลังงาน และการนำไฟฟ้า
(2 cm x 2 cm x1 mm)	8284

ตารางที่ 3.1 ชนิดและวัตถุประสงค์ในการใช้แผ่นฐานแบบต่างๆ



รูปที่ 3.2 การเตรียมแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si [4]



ล้างใน Acetone โดยใช้ เครื่อง Ultrasound เป็น เวลา 20 นาที



รูปที่ 3.3 การเตรียมแผ่นกระจกใส Corning # 7059 [4]

สำหรับการเตรียมแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si นั้นการควบคุมเวลาในการทำ Mirror Etching ให้มีความเหมาะสมที่ประมาณ 40-50 วินาทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้า ใช้เวลาในการกัดสั้นกว่านี้ผิวแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si จะยังมีลักษณะที่หยาบเกินไป แต่ถ้า เวลาที่ใช้ในการกัดนานกว่านี้ผิวแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si ก็จะถูกกัดมากจนบางเกินไป และมี ลักษณะหยาบตามรอยเกรนอีกครั้งดังแสดงในรูปที่ 3.4 ซึ่งรอยเกรนดังกล่าวจะทำให้เซลล์ แสงอาทิตย์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมีกระแสร้วมากที่บริเวณรอยต่อ และมีประสิทธิภาพต่ำ

นอกจากนี้ก่อนน้ำแผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si ที่เตรียมไว้แล้วมาใช้งานจะต้องทำการกัด ผิวออกไซด์ออกก่อนด้วยวิธี Slight Etching ด้วยน้ำยาเคมี HF:DI water = 1:10 เป็นเวลา 2 นาที และล้างด้วย DI water แล้วเป่าให้แห้งด้วยก๊าซ N₂



รูปที่ 3.4 แผ่นเวเฟอร์ของผลึก mc-Si ที่ทำการกัดผิวด้วยวิธี Mirror Etching ที่เวลาต่างๆ

3.2.2 การเคลือบชั้นอะลูมิเนียม

การเคลือบชั้น AI ในงานวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีไอระเหยในสุญญากาศด้วยเครื่อง Metallic Evaporator ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมากและราคาถูก รูปที่ 3.5 (ก) แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง และรูปที่ 3.5 (ข) แสดงเครื่อง Metallic Evaporator ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้ โดยหลักการทำงาน ของเครื่องมีดังนี้ [5] คือ โลหะที่ถูกใช้เป็นตัว Evaporant (Source) จะถูกใส่เอาไว้ใน Boat ที่ทำ จากทังสเตน และทั้ง Source, Boat และแผ่นฐาน จะอยู่ภายในแชมเบอร์ที่ถูกดูดอากาศออกด้วย ปั้มสุญญากาศ Oil Diffusion Pump จนมีความดันเหลือประมาณ 10⁶ Torr หลังจากนั้นจึงทำการ ปล่อยกระแสที่มีค่าสูงผ่าน Boat เมื่ออุณหภูมิของ Boat สูงเกินกว่าจุดกลายเป็นไอของโลหะที่เป็น Source ที่ความดันดังกล่าว โลหะก็จะกลายเป็นไอพุ่งออกไปด้วยพลังงานจลน์ไปเกาะติดอยู่บน แผ่นฐาน ซึ่งโดยทั่วไปจะมี Shutter คั่นอยู่ระหว่าง Source กับแผ่นฐาน และมี Detector ทำหน้าที่ วัดความหนาของชั้นโลหะที่เคลือบขึ้นด้วย



รูปที่ 3.5 (ก) ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง Metallic Evaporator (ข) เครื่อง Metallic Evaporator ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้

3.2.3 การปลูกฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน

ฟิล์มบาง a-Si:H สามารถผลิตได้หลายวิธีจากวัตถุดิบชนิดของแข็งและก๊าซ ในอดีตฟิล์ม บาง a-Si:H เคยถูกผลิตด้วยวิธี Themal Evaporation และ Sputtering จากวัตถุดิบของแข็ง แต่ใน ปัจจุบันวิธี Glow Discharge Plasma CVD เป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด เพราะสามารถผลิต ฟิล์มบาง a-Si:H ได้จากวัตถุดิบที่เป็นก๊าซให้มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีดังนั้น การปลูกฟิล์มบาง a-Si:H ในงานวิทยานิพนธ์นี้จึงเลือกใช้วิธี Glow Discharge Plasma CVD ที่มี โครงสร้างของระบบและรายละเอียดต่างๆ ในการปลูกฟิล์มดังต่อไปนี้ [6] คือ

3.2.3.1 โครงสร้างของระบบ Glow Discharge Plasma CVD

ในการปลูกฟิล์มบาง a-SI:H ในงานวิทยานิพนธ์นี้ใช้เครื่อง Glow Discharge Plasma CVD ที่ใช้สนามไฟฟ้าย่านความถี่คลื่นวิทยุที่13.56 MHz (Radio Frequency) โดยมีหลักการ ทำงานคือ ก๊าซดิบต่างๆ จะถูกส่งเข้าแชมเบอร์และก๊าซดิบเหล่านี้จะถูกสนามไฟฟ้าความถี่ย่าน คลื่นวิทยุ กระตุ้นให้แตกตัวเป็นพลาสมา ทำให้อะตอมของธาตุต่าง ๆ ถูกแยกให้ไปเกาะติดเป็น ฟิล์มบางบนแผ่นฐานที่วางอยู่บนฐานร้อนโดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะต้องควบคุมดังนี้คือ ปริมาณ การไหลของก๊าซ ความดันภายในแชมเบอร์ กำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซ และอุณหภูมิของ แผ่นฐาน รูปที่ 3.6 แสดงแผนผังของระบบ Glow Discharge Plasma CVD สำหรับปลูกฟิล์มบาง a-Si:H และรูปที่ 3.7 แสดงระบบ Glow Discharge Plasma CVD ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ

1) เครื่องซีวีดี

เครื่องซีวีดี ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังต่อไปนี้

 แชมเบอร์ชนิดแก้วไพเรกซ์ (Pyrex Chamber) มีลักษณะเป็นครอบแก้ว ทรงกระบอกสูงประมาณ 40 cm หนา 5 mm มีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนด้านล่าง 22 cm และเส้น ผ่านศูนย์กลางส่วนด้านบน 12 cm ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ทำหน้าที่เป็นภาชนะสุญญากาศ โดยวาง คว่ำประกบอยู่บนฐานเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Flange) และมียางแพ็กกิง (L Type Packing Rubber) เป็นตัวเก็บสุญญากาศ ภายในของแชมเบอร์มีจานโลหะกลมทำจากผลึกโพลี ซิลิกอนคาร์ไบด์ซึ่งสามารถหมุนรอบตัวเองได้สำหรับวางแผ่นฐานของชิ้นงาน และติดตั้งบนเตา ร้อนซึ่งเปลี่ยนอุณหภูมิได้จากอุณหภูมิห้องถึงประมาณ 400°C ด้านล่างสุดของแชมเบอร์มีท่อ โลหะต่อไปสู่เครื่องสูบสุญญากาศซนิดโรตารี (Rotary Vacuum Pump) และด้านข้างของแชมเบอร์ มีวาล์วสำหรับเปิดปิดควบคุมการปล่อยก๊าซเข้าแชมเบอร์

2. เครื่องกำเนิดสนามไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ ทำหน้าที่กำเนิดสนามไฟฟ้า แรงดันสูงสำหรับกระตุ้นให้ก๊าซแยกสลายตัวเป็นพลาสมา โดยต่อเข้าสู่แชมเบอร์ด้วยสายไฟฟ้า ชนิดแกนร่วม ก่อนเข้าแชมเบอร์จะมีกล่องแมตชิง (Matching Box) ซึ่งประกอบด้วยขดลวดและตัว เก็บประจุสำหรับปรับให้อิมพีแดนซ์ของเครื่องกำเนิดสนามไฟฟ้าความถี่วิทยุมีค่าเท่ากับอิมพีแดนซ์ ของโหลด (พลาสมา) ต่อจากกล่องแมตชิงลงมาจะเป็นขั้วไฟฟ้าแอโนดซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะ จานกลม และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm และมีรูพรุนด้านล่างกระจายอยู่ทั่ว ก๊าซจากภายนอก แชมเบอร์จะไหลเข้าสู่ขั้วแอโนดนี้และไหลผ่านรูพรุนกระจายลงสู่บริเวณที่วางแผ่นฐานในลักษณะ คล้ายฝักบัว (Air Shower) ส่วนฐานโลหะที่วางแผ่นฐานจะต่อลงดินและทำหน้าที่เป็นขั้วแคโทด ซึ่ง การควบคุมอุณหภูมิของเตาความร้อนที่ต่อกับขั้วแคโทดใช้วิธีโซลิดสเตตรีเลย์

2) ระบบการจ่ายก๊าซและควบคุมก๊าซ

ก๊าซดิบที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงมากระดับ 99.9999 % ขึ้นไป เจือจางด้วยก๊าซไฮโดรเจนด้วยความเข้มข้มตามความเหมาะสม ดังนี้

ก๊าซไซเลน SiH₄ /H₂ = 10 % บรรจุอยู่ในถังก๊าซขนาด 40 ลิตร

ก๊าซไดโบเรน B₂ H₆ /H₂ = 500 ppm บรรจุอยู่ในถังก๊าซชนาด 10 ลิตร ใช้สำหรับโด๊ปให้ a-Si:H เป็นชนิด p

ก๊าซฟอสฟีน PH₃ /H₂ = 500 ppm บรรจุอยู่ในถังก๊าซชนาด 10 ลิตร ใช้สำหรับโด๊ปให้ a-Si:H เป็นชนิด n

ก๊าซเหล่านี้บรรจุอยู่ในถังก๊าซด้วยความดันสูงประมาณ 120 kg/cm² จากถังก๊าซจะต่อท่อ เหล็กกล้าไร้สนิมและฟิลเตอร์กรองฝุ่นขนาด 50 μm แล้วต่อเข้ากับก๊าซเรกูเลเตอร์ (Gas Regulator) ซึ่งเป็นตัวลดความดันก๊าซให้ลดลงเหลือประมาณ 1-2 kg/cm² ต่อจากนั้นจะมีวาล์ว และมาตรวัดอัตราการไหลของก๊าซ (0-100 cc/min) โดยอัตราการไหลของก๊าซนี้จะถูกควบคุมด้วย วาล์วชนิดเข็ม (Needle Valve) ก๊าซต่าง ๆ จะไหลไปรวมกันที่วาล์วสามทางและไหลไปสู่แชมเบอร์ หรือลงไปสู่เครื่องสูบสุญญากาศแล้วแต่ความต้องการ เนื่องจากกาซดิบเหล่านี้เป็นก๊าซพิษ อันตรายและบางชนิดไวไฟมาก การใช้งานจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าต้องไม่มีการรั่วออกสู่ ภายนอก (กรณีก๊าซไซเลนนั้น นอกจากเป็นก๊าซพิษแล้ว ถ้ารั่วและสัมผัสกับออกซิเจนจะติดไฟ ทันทีแม้จะไม่มีเปลวไฟจากที่อื่นเป็นต้นเพลิง) รูปที่ 3.9 แสดงลักษณะการติดตั้งถังก๊าซและก๊าซ เรกูเลเตอร์ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการรั่วทั้งด้วยวิธีสูบสุญญากาศและวิธีเพิ่มความดัน



รูปที่ 3.6 แผนผังของระบบ Glow Discharge Plasma CVD สำหรับปลูกฟิล์มบาง a-Si:H



รูปที่ 3.7 ระบบ Glow Discharge Plasma CVD ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์



รูปที่ 3.8 ครอบแก้วสุญญากาศสำหรับปลูกฟิล์มบาง a-Si:H



รูปที่ 3.9 ลักษณะการติดตั้งถังก๊าซและก๊าซเรกูเลเตอร์

3.2.3.2 การเกิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน

ฟิล์มบาง a-Si:H ที่ผลิตโดยกระบวนการ Glow Discharge Plasma CVD นั้น พลาสมา ของก๊าซภายในแชมเบอร์ สามารถเกิดขึ้นได้จากอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งความเร็วภายใต้สนามไฟฟ้าวิ่ง ชนกับโมเลกุลของก๊าซ ทำให้ก๊าซเกิดการแตกตัวเป็นไอออน (Ionization) โดยพลังงานที่ใช้ในการ แตกตัวเป็นไอออน จะมีค่าประมาณ 10 - 20 eV หลังจากนั้นที่บริเวณผิวของแผ่นฐานก็จะทำการ ดูดซับไอออนและโมเลกุลของก๊าซเอาไว้เกิดเป็นฟิล์มบาง a-Si:H ขึ้น

สำหรับการปลูกฟิล์มบาง a-Si:H ในงานวิทยานิพนธ์นี้เริ่มต้นด้วยการติดตั้งแผ่นฐาน และ ทำการเพิ่มอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิแผ่นฐานสูงตามต้องการแล้ว จึงเริ่มปล่อยก๊าซดิบต่าง ๆ ที่เปิดขัง ไว้ในท่อให้ไหลเข้าแชมเบอร์ด้วยอัตราที่กำหนดและควบคุมความดันภายในแชมเบอร์ให้คงที่ตาม ค่าที่กำหนด ต่อจากนั้นก็เริ่มป้อนสนามไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุเพื่อทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออน โดยใช้กำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซที่เหมาะสม ตารางที่ 3.2 แสดงเงื่อนไขโดยสรุปสำหรับการ ปลูกฟิล์ม a-Si:H ในงานวิทยานิพนธ์นี้

การทำดิสชาร์จ	แบบคาปาซิเตอร์ ที่ความถี่ 13.56 MHz
กำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซ	5-20 W
อุณหภูมิแผ่นฐาน	190°C
ความดันก่อนการปลูกฟิล์ม	<0.01 Torr
ความดันขณะปลูกฟิล์ม	0.3-1.1 Torr
ความสูงของขั้ว 🕜 👝	10 cm
ปริมาณการไหลของก๊าซแต่ละชนิด	15-60 cc/min
ชนิดของก๊าซในถัง	$SiH_4/H_2 = 10\%$
าฬาลงกรณมา	$PH_{3}/H_{2} = 500 \text{ ppm}$
9	$B_2 H_6 / H_2 = 500 \text{ ppm}$

ตารางที่ 3.2 เงื่อนไขโดยสรุปสำหรับการปลูกฟิล์ม a-Si:H ในงานวิทยานิพนธ์นี้

เมื่อปลูกฟิล์มได้ความหนาตามต้องการแล้ว ก็ปิดสนามไฟฟ้าคลื่นวิทยุ แล้วจึงลดอุณหภูมิ ของแผ่นฐานให้ถึงอุณหภูมิห้อง โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ส่วนก๊าซดิบที่เหลือในท่อก็ต้อง ระบายทิ้งให้หมด เมื่อก๊าซดิบหมดแล้วให้ไล่ (Purge) ก๊าซดิบที่ตกค้างอีกครั้งด้วยก๊าซ N₂ จากนั้น เมื่ออุณหภูมิของแผ่นฐานลดถึงอุณหภูมิห้องแล้วจึงปรับความดันภายในแชมเบอร์ให้สูงขึ้นถึง สภาพบรรยากาศด้วยก๊าซ N₂ และนำฟิล์มที่ได้ออกจากแชมเบอร์

3.2.4 การปลูกฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงอินเดียมดีบุกออกไซด์

ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดี และยอมให้แสงทะลุผ่านดี ในงาน วิทยานิพนธ์นี้จึงเลือกใช้ฟิล์ม ITO เป็นขั้วไฟฟ้าด้านรับแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวัสดุเริ่มต้นของ ITO คือ สารประกอบของ In₂O₃ และ SnO₂ ที่มีอัตราส่วนน้ำหนักของ In:Sn = 95:5 โดยประมาณ นำมาอัดเป็นเม็ด Pellet มีลักษณะแสดงดังรูปที่ 3.10 และวิธีที่ใช้ในการปลูกฟิล์มคือวิธี Electron Beam Evaporator ซึ่งมีข้อดีคือเป็นกระบวนการที่สะอาด ปราศจากสารเจือปน มีพารามิเตอร์ เงื่อนไขในการควบคุมน้อย และสะดวกในการทำงาน



รูปที่ 3.10 เม็ด pellet ของ ITO

เครื่อง Electron Beam Evaporator นี้ประกอบด้วยแชมเบอร์ที่ถูกทำให้เป็นสุญญากาศ ด้วย Oil diffusion Pump, ตัวยึดแผ่นฐาน (Holder) สำหรับติดตั้งแผ่นฐาน, แผ่นฐาน (Substrate) ที่ถูกติดตั้งเหนือเบ้า (Crucible) สำหรับติดตั้งเป้า (Target) ประมาณ 30 cm, Vibrating Quartz Microbalance ซึ่งทำหน้าที่วัดอัตราการปลูกฟิล์ม, Heater (Tungsten Lamp) ทำหน้าที่เพิ่ม อุณหภูมิให้กับแผ่นฐาน, Thermocouple ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิของแผ่นฐาน, แหล่งจ่ายลำแสง อิเล็กตรอน (Electron Beam) และ Shutter ทำหน้าที่บังแผ่นฐานไว้ในขณะที่ยังไม่ต้องการปลูก ฟิล์ม ดังแสดงในรูปที่ 3.11 และรูปที่ 3.12 แสดงเครื่อง Electron Beam Evaporator ที่ใช้ในงาน วิทยานิพนธ์นี้





To vacuum pur

รูปที่ 3.12 เครื่อง Electron Beam Evaporator ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้

ในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้ทำการทดลองปลูกฟิล์ม ITO เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าและ ทางแสง โดยใช้แผ่นกระจกใส Corning # 7059 เป็นแผ่นฐานที่ใช้ในการทดลอง และทำการ เปลี่ยนค่าอุณหภูมิของแผ่นฐานค่าต่าง ๆ คือ 100°C 150°C 200°C 250°C และ 300°C เพื่อหา อุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้คุณสมบัติของฟิล์ม ITO ที่ดีที่สุดในการนำไปใช้ประดิษฐ์เซลล์ แสงอาทิตย์ต่อไป โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งคงค่าไว้ในการทดลองนี้คือ อัตราการปลูกฟิล์ม, ความดันออกซิเจน, ความหนาของฟิล์ม และความเร็วในการหมุนตัวยึดแผ่นฐาน [7] แสดงดัง ตารางที่ 3.3

Target	In_2O_3 : SnO ₂
อัตราการปลูกฟิล์ม	1-2 Å /sec
ความดันก่อนการปลูก	< 7x10 ⁻⁶ Torr
ความดันออกซิเจน	5x10 ⁻⁴ Torr
ควา <mark>มหนาของฟิล์ม</mark>	2,000 Å
ความเร็วในการหมุนตัวยึดแผ่นฐาน	5 rpm.

ตารางที่ 3.3 เงื่อนไขในการปลูกฟิล์ม ITO

สำหรับการปลูกฟิล์ม ITO จะเริ่มต้นจากการติดตั้งแผ่นฐานที่จะเคลือบฟิล์ม ITO และเม็ด pellet ของ ITO ลงไปในแชมเบอร์ แล้วปิดแชมเบอร์ตั้งค่าอุณหภูมิของแผ่นฐาน และความเร็วใน การหมุนตัวยึดแผ่นฐานตามต้องการ แล้วดูดให้เป็นสุญญากาศที่ความดันต่ำกว่าประมาณ 7x10⁻⁶ Torr จากนั้นก่อนที่จะทำยิงลำแสงอิเล็กตรอนไปยังเม็ด Pellet ของ ITO จึงทำการปล่อยก๊าซ ออกซิเจนเข้าไปในแชมเบอร์ให้มีความดันประมาณ 5x10⁻⁴ Torr และใช้ลำแสงอิเล็กตรอนยิงเม็ด Pellet ของ ITO ให้ระเหยกลายเป็นไอ เมื่อเปิด Shutter ก็จะเกิดการเคลือบของฟิล์ม ITO ลงบน แผ่นฐานรูปที่ 3.13 แสดงลักษณะของฟิล์ม ITO ที่ปลูกได้ที่อุณหภูมิแผ่นฐานต่างๆกัน



รูปที่ 3.13 ลักษณะของฟิล์ม ITO ที่ปลูกได้ที่อุณหภูมิแผ่นฐานต่างๆกัน

หลังจากที่ได้ฟิล์มบางของ ITO แล้วจึงนำไปวัดคุณสมบัติทางแสงและคุณสมบัติทาง ไฟฟ้า สำหรับการวัดคุณสมบัติทางแสงทำโดยการวัดการทะลุผ่านของแสง โดยใช้ช่วงสเปกตรัม ของแสงที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 250-2,500 nm ด้วยเครื่อง UV Spectrophotometer รุ่น Shimadsu UV210 ดังแสดงในรูปที่ 3.14 และผลการวัดที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.15 ซึ่งพบว่าที่อุณหภูมิ แผ่นฐาน 250°C จะมีการทะลุผ่านของแสงดีที่สุด และที่อุณหภูมิแผ่นฐานต่ำกว่า 250°C การ ทะลุผ่านของแสงจะมีค่าต่ำเนื่องมาจากฟิล์มมีสีน้ำตาลมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิแผ่นฐานลดลง

ส่วนการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มทำโดยใช้เครื่อง Multimeter ซึ่งเป็นการวัดค่า ความต้านทานของฟิล์ม ITO เพื่อศึกษาแนวโน้มอย่างคร่าวๆ ผลการวัดที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.16 พบว่าที่อุณหภูมิแผ่นฐานต่ำค่าความต้านทานมีค่าสูง แต่เมื่ออุณหภูมิแผ่นฐานสูงขึ้นตั้งแต่ 150°C เป็นต้นไปค่าความต้านทานจะมีค่าต่ำลงและมีค่าต่ำที่สุดเมื่ออุณหภูมิแผ่นฐานเท่ากับ 250°C ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าที่อุณหภูมิแผ่นฐานเท่ากับ 250°C เป็นอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมกับการใช้ งานมากที่สุด



รูปที่ 3.14 เครื่อง UV Spectrophotometer สำหรับวัดสเปกตรัมสัมประสิทธิ์การทะลุผ่านแสง







รูปที่ 3.16 ผลการวัดอิทธิพลของอุณหภูมิแผ่นฐานที่มีต่อความต้านทานของฟิล์ม ITO และ การ ทะลุผ่านของแสง (วัดที่ความยาวคลื่น 810 nm) โดยที่ฟิล์ม ITO หนา 1,500 Å

3.3 การวัดและการพัฒนาโปรแกรมการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์

การวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยแสงอาทิตย์เทียม มีแผนภาพของ ระบบการวัดแสดงในรูปที่ 3.17 ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนดังนี้คือ

- ต้นกำเนิดแสงอาทิตย์เทียม เป็นหลอดไฟชนิด High Pressure Xe Arc Lamp ของ บริษัท Kratos ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีฟิลเตอร์ซึ่งสามารถทำให้ได้แสงเอาต์พุตที่มีความ เข้มเท่ากับ AM1 AM1.5 และ AM2 โดยลำแสงมีรูปเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 cm
- 2) เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและวัดกระแสไฟฟ้า
- คอมพิวเตอร์
- 4) เซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานชนิดผลึกเดี่ยว Si เพื่อใช้ปรับและเทียบค่าความเข้มแสง ตามต้องการ



รูปที่ 3.17 แผนภาพของระบบการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยแสงอาทิตย์เทียมและคอมพิวเตอร์

แหล่งกำเนิดแรงดัน /กระแสไฟ

KRATOS

รูปที่ 3.18 แสดงวงจรสมมูลของการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์โดย หลักการวัดคือ ใช้การไบแอสแรงดันแบบตาม (Forward Bias) ให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ขณะรับแสง และเปลี่ยนค่าของแรงดันตั้งแต่ 0 โวลต์ (Short Circuit) จนถึงค่าที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตจาก เซลล์แสงอาทิตย์กลายเป็นศูนย์ (Open Circuit) การไบแอสตามจากภายนอกเข้าไปยังเซลล์ แสงอาทิตย์เช่นนี้ จะทำให้แถบพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนสภาพเป็นแนวราบ (Flat Band) ทำให้กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตลดลงตามค่าแรงดันไฟฟ้าจนกลายเป็น 0 ในที่สุด ซึ่งผลการวัด ที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำไปเขียนกราฟและใช้คำนวณหาพารามิเตอร์ที่สำคัญต่างๆ ต่อไป รูปที่ 3.19 แสดงเครื่องวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้



รูปที่ 3.18 วงจรสมมูลของการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์



รูปที่ 3.19 เครื่องวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้

lle

ข้อมูลที่ได้จากการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์เป็นผลการทดลองที่มี ความสำคัญมาก นอกจากต้องใช้ระบบวัดที่มีประสิทธิภาพแล้ว การจัดการข้อมูลเพื่อนำมา วิเคราะห์และสรุปผลก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา เซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในงานวิทยานิพนธ์นี้จึงเลือกใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อ เขียนโปรแกรมสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญต่างๆจากข้อมูลที่ได้จากการวัด เช่น

- 1) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Voltage ย่อว่า V_{MAX})
- 2) กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Current ย่อว่า J_{MAX})
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power ย่อว่า P_{MAX}) ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างแรงดันไฟฟ้า สูงสุดและกระแสไฟฟ้าสูงสุด

$$P_{MAX} = V_{MAX} \times J_{MAX}$$

- ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Open Circuit Voltage ย่อว่า V_{oc}) ซึ่งเป็นแรงดันไฟพ้าที่ วัดได้เมื่อค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดมีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์ แสงอาทิตย์
- 5) ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit Current ย่อว่า J_{sc}) ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่วัด ได้เมื่อค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์ แสงอาทิตย์
- ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ (Fill Factor ย่อว่า FF) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าสูงสุด ต่อผลคูณของแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

$$F.F. = \frac{V_{MAX} \times J_{MAX}}{V_{OC} \times J_{SC}} \times 100 \%$$

7) ประสิทธิภาพในการแปรพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ (Efficiency)

$$\eta = \frac{P_{MAX}}{P_{IN}} \times 100 \%$$

โดยรายละเอียดของโปรแกรมที่เขียนขึ้นทั้งหมดจะแนบอยู่ในส่วนภาคผนวกของ วิทยานิพนธ์นี้

3.4 การวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ 3.20 แสดงแผนผังการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งทำ การวัดแบบไม่มีการไบอัส และรูปที่ 3.21 แสดงระบบการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการวัดในวิทยานิพนธ์นี้



รูปที่3.20 แผนผังการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์



รูปที่ 3.21 ระบบการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองต่อแสงของเซลล์แสงอาทิตย์

ในบทนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ของอะมอร์พัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน โดยอธิบายการเตรียมแผ่นฐาน การ ประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ การวัดลักษณะ สมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ และรายงานผลการทดลองปลูกฟิล์มขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงชนิด ITO

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของฟิล์ม ITO ที่ปลูกได้ พบว่าที่อุณหภูมิ แผ่นฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกฟิล์ม ITO คือ 250°C ซึ่งให้ค่าการทะลุผ่านของแสงสูง ที่สุด และมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำสุด เงื่อนไขการปลูกฟิล์ม ITO ที่ได้นี้จะนำไปใช้ประกอบใน การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ในบทต่อไป

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4

ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/Al

4.1 บทนำ

เพื่อที่จะประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI ให้ได้ ประสิทธิภาพสูงที่สุด ในงานวิทยานิพนธ์นี้จึงเริ่มต้นด้วยการหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดของการปลูกชั้น ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 สำหรับบทนี้เป็นการ พิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H รวมทั้งแสดงผลการทดลองที่ ได้ โดยทำการทดลองประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์สองตัวด้วยกันคือ ค่า กำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซ และค่าความหนาของฟิล์มบาง n-a-Si:H จากนั้นจึงทำการวัดค่า การทะลุผ่านของแสงของฟิล์มบาง n-a-Si:H, ลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ และ ผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาบริเวณ ชั้นทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์และนำผลที่ได้มาพิจารณาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

4.2 ผลการศึกษาลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อทำการเปลี่ยนค่า กำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซของการปลูกฟิล์มบาง n-a-Si:H

ในการหาเงื่อนไขของการปลูกฟิล์มบาง n-a-Si:H ของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI นั้น เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซของการ ปลูกฟิล์มบาง n-a-Si:H เป็นค่าต่างๆ ทั้งหมด 4 ค่าด้วยกันคือ 6 W, 10 W, 15 W และ 20 W โดย คงค่าพารามิเตอร์ความหนาของชั้น n-a-Si:H เอาไว้ที่ 500 Å จากนั้นจึงนำเซลล์แสงอาทิตย์ที่ ประดิษฐ์ได้ไปทำการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ และวัดค่าผลตอบสนองทาง แสงของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยแสงอาทิตย์เทียม

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้น ถูกนำไปวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยแสงอาทิตย์เทียม โดยกำหนดให้เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละตัวมีพื้นที่เท่าๆ กันคือ 0.25-0.3 cm² และนำค่าเอาต์พุตที่ได้ของแต่ละค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ และค่าประสิทธิภาพ กับค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซดังแสดงในรูปที่ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ตามลำดับ



และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซ (RF Power)



และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายก๊าซ (RF Power)

จากรูปที่ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 มีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

1) เมื่อค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซมีค่าเพิ่มขึ้น ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดจะยังคงมี ค่าคงที่ประมาณ 0.45 V เนื่องจากค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดนี้ขึ้นอยู่กับชั้นทำงานของเซลล์ แสงอาทิตย์ โดยจะมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของค่าช่องว่างพลังงานของชั้นทำงาน สำหรับโครงสร้าง นี้พาหะอิสระส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ชั้น p-mc-Si ซึ่งมีค่าของช่องว่างพลังงานอยู่ที่ประมาณ 1.1 eV ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H จึงไม่ทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด เปลี่ยนแปลงไป

 2) ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อค่ากำลังไฟฟ้าในการ แยกสลายก๊าซมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 28 mA/cm² เนื่องจากที่ค่ากำลังไฟฟ้าค่าสูงชั้น ฟิล์มบาง n-a-Si:H จะมีค่าการทะลุผ่านของแสงสูงกว่าทำให้แสงเดินทางเข้าสู่ชั้นทำงานได้มากขึ้น ส่งผลให้พาหะอิสระเกิดได้มากขึ้น กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจึงมีค่าเพิ่มขึ้น

3) ค่าฟิลล์แฟกเตอร์มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลาย ก๊าซมีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่าประมาณ 47 % เนื่องจากที่ค่ากำลังไฟฟ้าค่าสูงโครงสร้างของชั้นฟิล์ม บาง n-a-Si:H มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้พาหะที่เกิดขึ้นสามารถวิ่งผ่านไปได้อย่างสะดวก ขึ้น ซึ่งเป็นการลดความต้านทานอนุกรมของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดจากชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H ให้มี ค่าลดลงส่งผลให้ค่าฟิลล์แฟกเตอร์มีการเพิ่มขึ้น

 มื่อค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซมีค่าเพิ่มขึ้น ค่าประสิทธิภาพที่ได้มีค่าใกล้เคียง กันคือประมาณ 6 % เนื่องจากค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

รูปที่ 4.6 แสดงผลการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ค่า กำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซต่างๆ กัน พบว่าเอาต์พุตที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยค่า เอาต์พุตทั้งหมดที่ได้อยู่ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ประมาณ 400-1,200 nm และมีจุดสูงสุดของ เอาต์พุตแต่ละเส้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 nm ซึ่งใกล้เคียงกับค่าช่องว่างพลังงานของชั้น p-mc-Si ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ชั้นที่ผลิตพาหะโฟโตของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างแบบที่ 1 นี้คือ p-mc-Si

หลังจากทำการทดลองประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์โดยการเปลี่ยนค่ากำลังไฟฟ้าในการแยก สลายก๊าซแล้ว พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกัน เนื่องจากระบบ Glow Discharge Plasma CVD ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นชนิด vertical direction คือสนามไฟฟ้าย่านความถี่วิทยุอยู่ในทิศตั้งฉากกับแผ่นฐาน ส่งผลให้มีบริเวณ ของการแยกสลายก็าซแคบ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซจึงมี อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟิล์มน้อย และกำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซเท่ากับ 6 W เป็นเงื่อนไขที่ให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังนั้นจึงเลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าใน การแยกสลายก๊าซเท่ากับ 6 W ในการทดลองเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ตัวต่อไป



รูปที่ 4.5 สเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่กำลังไฟฟ้า ในการแยกสลายก๊าซเท่ากับ 6 W, 10 W, 15 W และ 20 W ตามลำดับ

4.3 ผลการศึกษาลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อทำการเปลี่ยน ค่าความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H

ค่าพารามิเตอร์ตัวต่อไปที่ได้เปลี่ยนแปลงค่าคือ ค่าความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H โดยเปลี่ยนเป็นค่าต่างๆ 4 ค่า คือ 100 Å, 250 Å, 500 Å และ750 Å





เซลล์แสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ได้ ถูกนำไปวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตด้วยแสงอาทิตย์เทียม โดยเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละตัวมีพื้นที่ประมาณ 0.25-0.3 cm² รูปที่ 4.6, 4.7, 4.8 และ 4.9 แสดง ลักษณะสมบัติเอาต์พุต จากรูปดังกล่าวมีข้อสังเกตดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H มีอิทธิพลต่อค่าแรงดันไฟฟ้า วงจรเปิดน้อย ทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดมีประมาณ 0.45 V

2) กระแสไฟฟ้าลัดวงจรมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H มีค่าเพิ่มขึ้น จาก 100 Å ถึง 500 Å และค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะลดลงเมื่อความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H หนากว่า 500 Å ในกรณีที่ชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H บางเกินไป อาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่ว อันเนื่องจากฟิล์มมีบริเวณรั่ว เมื่อความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H เพิ่มขึ้น การเกิดรอยต่อ (junction) จะมีความสมบูรณ์ดีขึ้น ค่าสนามไฟฟ้าภายในของเซลล์แสงอาทิตย์จะมีค่าสูงขึ้นส่งผล ให้การกวาดพาหะที่เกิดขึ้นในชั้นทำงานดียิ่งขึ้น ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรจึงมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ ความหนามีค่ามากเกินไป ฟิล์มบาง n-a-Si:H จะดูดกลืนแสงเอาไว้มากขึ้นและมีค่าความ ต้านทานอนุกรมมากขึ้น การทะลุผ่านของแสงเข้าสู่ชั้นทำงานจึงมีค่าน้อยลง กระแสไฟฟ้าลัดวงจร จึงมีค่าลดลง

3) ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ที่วัดได้มีลักษณะของกราฟเช่นเดียวกันกับค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร คือมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H เท่ากับ 100-500 Å จากนั้นจึงมีค่า ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H ที่มีค่าความหนาน้อยฟิล์มจะเกิดการทะลุของ รอยต่อได้ง่ายและมีค่ากระแสรั่วมากทำให้ค่าฟิลล์แฟกเตอร์มีค่าน้อย แต่ถ้าค่าความหนามีค่ามาก ค่าความต้านทานอนุกรมจะมีค่ามากขึ้นทำให้ค่าฟิลล์แฟกเตอร์มีค่าลดลง

 4) ค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะมีสูงสุดที่ความหนาชั้น n-a-Si:H ที่เหมาะสม กราฟที่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกราฟของค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร และค่าฟิลล์แฟกเตอร์ เนื่องมาจากค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

รูปที่ 4.10 แสดงผลการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อ เฮเทอโรแบบที่ 1 พารามิเตอร์ในรูปคือ ความหนาของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H จากรูปพบว่า สเปกตรัมมีค่ายอดอยู่ที่ความยาวคลื่นแสงประมาณ 900-1,000 nm ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับ กรณีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนทั่วไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชั้นที่ผลิตพาหะของเซลล์ แสงอาทิตย์โครงสร้างเฮเทอโรแบบที่ 1 นี้คือชั้นของ p-mc-Si





ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITOn-a-Si:H/p-mc-Si/AI ที่ความเข้มแสง AM1

จากผลการศึกษาข้างต้น จึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพารามิเตอร์ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 (ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI) คือ ค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซที่ เหมาะสมสำหรับชั้น n-a-Si:H 6 W และค่าความหนาที่เหมาะสมของชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H คือ 500 Å

รูปที่ 4.11 แสดงตัวอย่างผลการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตกราฟ I-V ของเซลล์แสงอาทิตย์ รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 (ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI) โดยวัดที่ความเข้มแสง AM1 พบว่าค่า แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตวงจรเปิด (V_{oc}) มีค่าเท่ากับ 0.455 V กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (J_{sc}) มีค่าเท่ากับ 27.45 mA/cm² ประสิทธิภาพที่ได้มีค่าเท่ากับ 6.52 % และฟิลล์แฟกเตอร์มีค่าเท่ากับ 50.01 % จึงสรุปได้ว่าพาหะอิสระนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชั้นของ p-mc-Si

4.4 สรุป

ในบทนี้ได้รายงานผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 (ITO/ n-a-Si:H/p-mc-Si/AI) พบว่าชั้นที่ผลิตพาหะโฟโตคือ ชั้นของ p-mc-Si และเงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับการปลูกชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H คือ การปลูกด้วยค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซเท่ากับ 6 W และความหนาของฟิล์มเท่ากับ 500 A ซึ่งให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่ 6.52 %

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 5

ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/Al

5.1 บทนำ

ในบทที่ 4 ได้รายงานผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 คือ โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/ p-mc-Si/AI ได้ประสิทธิภาพสูงสุดประมาณ 6.52% ในบทที่ 5 นี้จะ รายงานผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 ซึ่งเป็นโครงสร้างที่แทรกชั้นของ i-a-Si:H เข้าไประหว่างชั้น n-a-Si:H และ p-mc-Si โดยในการทดลองได้มีการเปลี่ยนค่าความหนา ของฟิล์ม i-a-Si:H

5.2 ผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 และอิทธิพลของความหนา ของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H

เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 ประกอบด้วยรอยต่อของ ITO/n-a-Si:H/ i-a-Si:H/p-mc-Si/AI ซึ่งชั้นที่ผลิตพาหะโฟโตคาดว่าจะได้แก่ชั้น i-a-Si:H และ p-mc-Si เงื่อนไข สำหรับการปลูกฟิล์มชั้น n-a-Si:H คือ กำลังไฟฟ้าแยกสลายก๊าซเท่ากับ 6 วัตต์ และความหนา 500 A ซึ่งได้จากบทที่ 4

สำหรับในบทที่ 5 นี้ ได้เปลี่ยนแปลงความหนาของชั้น i-a-Si:H เป็นค่าต่างๆเท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2,000 Å และ 3,000 Å และกำหนดให้เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละตัวมีพื้นที่ประมาณ 0.25-0.3 cm² รูปที่ 5.1, 5.2, 5.3 และ 5.4 แสดงลักษณะสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ดังต่อไปนี้

ลถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์และความหนา ของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2,000 Å และ 3,000 Å



รูปที่ 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์และความหนา ของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เท่ากับ 500 Å, 1,000 Å, 2,000 Å และ 3,000 Å

เมื่อความหนาของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เพิ่มขึ้น ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดจะมีค่า
 เพิ่มขึ้นด้วยจนถึงค่าความหนาเท่ากับ 2,000 Å จากนั้นจึงมีค่าค่อนข้างคงที่เมื่อความหนามากกว่า
 2,000 Å เนื่องจากค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดนี้จะขึ้นอยู่กับชั้นทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
 โครงสร้างนี้ชั้นทำงานที่มีพาหะส่วนใหญ่เกิดขึ้นก็คือชั้น p-mc-Si และมีการเพิ่มบริเวณของชั้น
 ทำงานด้วยชั้น i-a-Si:H ส่งผลให้เมื่อค่าความหนาของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H ที่มีค่าช่องว่างพลังงาน
 ประมาณ 1.7-1.8 eV เพิ่มขึ้น ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดจึงมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

2) เมื่อค่าความหนาของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H มีค่าเพิ่มขึ้น ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรก็จะมี ค่าเพิ่มขึ้นด้วยจนถึงค่าความหนาเท่ากับ 2,000 Å จากนั้นจึงมีค่าลดลงเมื่อความหนามากกว่า 2,000 Å เนื่องจากค่าความหนาของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริเวณของชั้นทำงานมี มากขึ้นและพาหะที่เกิดก็จะมีมากขึ้นด้วย ดังนั้นค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรจึงมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อความหนามีค่ามากเกินไปฟิล์มบาง i-a-Si:H จะดูดกลืนแสงเอาไว้ทำให้การทะลุผ่านของ แสงเข้าสู่ชั้น p-mc-Si มีค่าน้อยลง ส่งผลให้พาหะที่เกิดในชั้น p-mc-Si มีจำนวนน้อยลง ถึงแม้ว่า จะการเกิดพาหะที่ชั้น i-a-Si:H จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้เนื่องจากค่าสนามไฟฟ้า ภายในยังคงมีค่าคงที่ถ้าค่าความหนาของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H มีค่ามาก พาหะที่เกิดขึ้นก็จะไม่ถูก กวาดออกไปได้ทั้งหมด ดังนั้นค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรจึงมีค่าลดลงตามไปด้วย

 ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ที่วัดได้มีลักษณะของกราฟลดลงเล็กน้อย เมื่อความหนาของฟิล์ม บาง i-a-Si:H มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากความหนาที่มีค่ามากขึ้นจะทำให้ความต้านทานมีค่ามากขึ้นทำ ให้ค่าฟิลล์แฟกเตอร์มีค่าลดลง

4) ค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาของชั้นฟิล์ม บาง i-a-Si:H กราฟที่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกราฟของค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

รูปที่ 5.5 แสดงผลการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีความหนาของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H เป็นพารามิเตอร์ จากรูปจะสามารถสังเกตได้ดังนี้

- 1) เมื่อชั้น i-a-Si:H บาง พาหะโฟโตส่วนใหญ่จะถูกผลิตในชั้น p-mc-Si ซึ่งทำให้ยอดของ สเปกตรัมอยู่ที่ประมาณ 1,000 nm
- 2) เมื่อชั้น i-a-Si:H มีความหนามากขึ้น สเปกตรัมจะเริ่มกว้างขึ้น และจะปรากฏยอด สเปกตรัมที่ความยาวคลื่นประมาณ 650-700 nm ซึ่งแสดงให้ทราบว่า ชั้น i-a-Si:H มี ส่วนร่วมในการผลิตพาหะโฟโตเช่นเดียวกับชั้น p-mc-Si







รูปที่ 5.6 ตัวอย่างผลการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI ที่ความเข้มแสง AM1

รูปที่ 5.6 แสดงตัวอย่างของผลการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อ เฮเทอโรแบบที่ 2 (ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI) โดยวัดที่ความเข้มแสง AM1 พบว่าค่า แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตวงจรเปิด (V_{oc}) มีค่าเท่ากับ 0.495 V กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (J_{sc}) มีค่าเท่ากับ 32.43 mA/cm² ประสิทธิภาพที่ได้มีค่าเท่ากับ 8.22 % และฟิลล์แฟกเตอร์มีค่าเท่ากับ 51.22 %

รูปที่ 5.7 แสดงผลการเปรียบเทียบสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ซึ่งได้แก่ โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI และ ITO/ n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI ตามลำดับ จากรูปพบว่ากรณีเซลล์แบบที่ 2 จะมีความกว้างของ สเปกตรัมมากกว่าแบบที่ 1 เนื่องจากเซลล์แบบที่ 2 มีข้อได้เปรียบที่ชั้นผลิตพาหะโฟโตนั้นมีทั้งชั้น i-a-Si:H และ p-mc-Si



รูปที่ 5.7 เปรียบเทียบสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ คือ โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI (กราฟเส้นสีดำ) และ ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI (กราฟเส้นสีน้ำเงิน)

5.3 สรุป

ในบทนี้ได้รายงานผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 คือ โครงสร้าง ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI พบว่าชั้นผลิตพาหะโฟโตได้แก่ i-a-Si:H และ p-mc-Si จากผล การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ พบว่าความหนาที่เหมาะสมของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H คือ 2,000 Å ซึ่งได้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดเท่ากับ 8.22 % และสเปกตรัม ผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แบบที่ 2 นี้กว้างกว่าแบบที่ 1 อย่างเห็นได้ชัดเจน



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 6

สรุป

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้รายงานผลการศึกษาการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน โดยมีผลการทดลองต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ได้กล่าวถึงโครงสร้างและหลักการทำงานพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอนทั้งสิ้น 2 แบบด้วยกันคือ
 1. โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ITO/n-a-Si:H/p-mc-Si/AI และ
 2. โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโร ITO/n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI

 รายงานผลการทดลองปลูกฟิล์มขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงชนิด ITO โดยผลการศึกษา คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของฟิล์ม ITO ที่ปลูกได้ พบว่าที่อุณหภูมิแผ่นฐานที่เหมาะสม ที่สุดสำหรับการปลูกฟิล์ม ITO คือ 250°C ซึ่งให้ค่าการทะลุผ่านของแสงสูงที่สุด และมีค่าความ ต้านทานไฟฟ้าต่ำสุด

 3. รายงานผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 1 (ITO/n-a-Si:H/ p-mc-Si/AI) ซึ่งพบว่าชั้นที่ผลิตพาหะโฟโตคือ ชั้นของ p-mc-Si และเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการ ปลูกชั้นฟิล์มบาง n-a-Si:H คือ การปลูกด้วยค่ากำลังไฟฟ้าในการแยกสลายก๊าซเท่ากับ 6 W และ ความหนาของฟิล์มเท่ากับ 500 Å ซึ่งให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่ 6.52 %

 4. รายงานผลการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรแบบที่ 2 คือ โครงสร้าง ITO/ n-a-Si:H/i-a-Si:H/p-mc-Si/AI พบว่าชั้นผลิตพาหะโฟโตได้แก่ i-a-Si:H และ p-mc-Si จากผลการ หาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ พบว่าความหนาที่เหมาะสมของชั้นฟิล์มบาง i-a-Si:H คือ 2,000 Å ซึ่งได้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดเท่ากับ 8.22 % และสเปกตรัม ผลตอบสนองทางแสงของเซลล์แบบที่ 2 นี้กว้างกว่าแบบที่ 1 อย่างเห็นได้ชัดเจน

จุฬาลงกรณมหาวทยาลย

รายการอ้างอิง

- [1] ดุสิต เครื่องาม. <u>สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1</u>. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- [2] สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว. <u>เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์</u>. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
- [3] ดุสิต เครื่องาม. <u>สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2</u>. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- [4] วรยุทธ วรสุบิน. <u>การผลิตขั้วโปร่งแสงจากอินเดียมดีบุกออกไซด์และการใช้งานในเซลล์แสง</u> <u>อาทิตย์</u>. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. (อัดสำเนา)
- [5] บรรยง โตประเสริฐพงศ์. <u>เทคโนโลยีและฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน</u>ำ. กรุงเทพ มหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. (อัดสำเนา)
- [6] ดุสิต เครืองาม, สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว. <u>รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ระยะที่ 1 เรื่อง ไดโอด</u> <u>เปล่งแสงแบบฟิล์มบางชนิดวัสดุอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวน</u>ำ. กรุงเทพมหานคร: ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2535. (อัดสำเนา)
- [7] ดุสิต เครื่องาม, ชุมพล อันตรเสน, บรรยง โตประเสริฐพงศ์. <u>รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์</u> <u>เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน</u>. : ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. (อัด สำเนา)

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ภาคผนวก

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้มีการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย แสงอาทิตย์เทียม โดยใช้โปรแกรมภาษา Basic บนเครื่อง NEC ต่อจากนั้น จึงนำ Data ไปคำนวณ ด้วยโปรแกรม MATLAB เพื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตและ แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต และคำนวณหาค่า V_{oc}, I_{sc}, FF, Efficiency ตามลำดับ โปรแกรม MATLAB ที่เขียนชื่อ "solarsim" มีรายละเอียดดังนี้

disp('Select the command');

disp(' 1. Import Data');

disp(' 2. Plot Graph');

disp(' 3. End');

```
mode=input('Enter your command : ');
```

switch mode

case 1

uiimport;

wait=input(");

name=input('Input Sample Number = ','s');

area=input('Input area : ');

i=data(1,5)+1;

V=data(2:i,1);

I=data(2:i,2);

P=V.*I;

Pmax=0;

for j=1:i-1;

if P(j)>Pmax;

Pmax=P(j);

k=j;

end

end

Vm=V(k);

Im=I(k);

lsc=l(1);

Voc=(V(i-2)+V(i-1))/2;

ff=Vm*Im*100/Voc/Isc;

eff=Pmax;

run solarsim;

case 2

disp('Choose number to plot graph');

disp(' 1. I-V Curve');

disp(' 2. P-V Curve');

disp(' 3. I-V Curve and P-V Curve');

gmode=input('Enter number : ');

switch gmode

case 1

Vstart=input('	Input Vstart = ');
Vend=input('	Input Vend = ');
lstart=input('	Input Istart = ');
lend=input('	Input lend = ');

infor=input('Do you want to show the output characteristics? (1:yes,2:no) : ');

clf;

```
plot(V,I,'Linewidth',2);
```

axis([Vstart Vend Istart lend]);

set(gca,'YTick',Istart:2:Iend,'LineWidth',2,'fontsize',18,'fontweight','bold',

'fontname','EucrosiaUPC');

ylabel('Output Current (mA/cm²)','fontsize',24,'fontweight','bold','fontname', 'EucrosiaUPC');

hold on;

```
plot(Vm,Im,'k+');
```

if infor==1

text(Vend-0.35,lend-1,['Cell No. = ',name],'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-1*Iend/20,['Area = ',num2str(area),' cm^2'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,lend-1-3*lend/20,['Jmax = ',num2str(Im),'mA/cm^2'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-4*Iend/20,['Voc = ',num2str(Voc),' V'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-5*Iend/20,['Jsc = ',num2str(Isc),' mA/cm^2'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35, lend-1-6*lend/20, 'Pinput = 100 mW/cm^2',

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,lend-1-8*lend/20,['Efficiency = ',num2str(eff),' %'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,lend-1-9*lend/20,['FF = ',num2str(ff), ' %'],'fontweight','bold');

else

```
text(Vend-0.35,lend-1,['Cell No. = ',name],'fontweight','bold');
```

disp('---Not show the output characteristics.---');

end

xlabel('Output Voltage (V)','fontsize',24,'fontweight','bold','fontname',

'EucrosiaUPC');

case 2

```
Vstart=input(' Input Vstart = ');
```

Vend=input(' Input Vend = ');

```
Pstart=input(' Input Pstart = ');
```

Pend=input(' Input Pend = ');

infor=input('Do you want to show the output characteristics? (1:yes,2:no) : '); clf;

plot(V,P,'Linewidth',2);

axis([Vstart Vend Pstart Pend]);

set(gca,'YTick',Pstart:1:Pend,'LineWidth',2,'fontsize',18,'fontweight','bold',

'fontname', 'EucrosiaUPC');

ylabel('Output Power (mW/cm^2)','fontsize',24,'fontweight','bold',

'fontname','EucrosiaUPC');

hold on;

plot(Vm,Pmax,'ro');

if infor==1

text(Vend-0.35,Pend-0.5,['Cell No. = ',name],'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Pend-0.5-1*Pend/20,['Area = ',num2str(area),' cm^2'], 'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Pend-0.5-2*Pend/20,['Vmax = ',num2str(Vm),' V'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Pend-0.5-4*Pend/20,['Voc = ',num2str(Voc),' V'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Pend-0.5-6*Pend/20,'Pinput = 100 mW/cm^2',

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Pend-0.5-8*Pend/20,['Efficiency = ',num2str(eff),' %'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Pend-0.5-9*Pend/20,['FF = ',num2str(ff), '%'],

'fontweight','bold');

else

text(Vend-0.35,Pend-0.5,['Cell No. = ',name],'fontweight','bold');

disp('---Not show the output characteristics.---');

end

xlabel('Output Voltage (V)','fontsize',24,'fontweight','bold',

case 3

Vstart=input(' Input Vstart = ');

Vend=input(' Input Vend = ');

Istart=input(' Input Istart = ');

lend=input(' Input lend = ');

Pstart=input(' Input Pstart = ');

Pend=input(' Input Pend = ');

infor=input('Do you want to show the output characteristics? (1:yes,2:no) : ');

clf;

[haxes,hline1,hline2]=plotyy(V,I,V,P);

axes(haxes(1));

set(hline1,'LineWidth',2);

axis([Vstart Vend Istart lend]);

box off;

set(gca,'YTick',Istart:2:Iend,'LineWidth',2,'fontsize',18,'fontweight','bold',

'fontname', 'EucrosiaUPC');

ylabel('Output Current (mA/cm^2)','fontsize',24,'fontweight','bold',

'fontname', 'EucrosiaUPC');

```
hold on;
```

plot(Vm,Im,'k+');

if infor==1

text(Vend-0.35, lend-1, ['Cell No. = ', name], 'fontweight', 'bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-1*Iend/20,['Area = ',num2str(area),' cm^2'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-2*Iend/20,['Vmax = ',num2str(Vm),' V'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-4*Iend/20,['Voc = ',num2str(Voc),' V'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-5*Iend/20,['Jsc = ',num2str(Isc),' mA/cm^2'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-6*Iend/20,'Pinput = 100 mW/cm^2',

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,Iend-1-7*Iend/20,['Pmax=',num2str(Pmax),' mW/cm^2'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35, lend-1-8*lend/20, ['Efficiency = ', num2str(eff), '%'],

'fontweight','bold');

text(Vend-0.35,lend-1-9*lend/20,['FF = ',num2str(ff), '%'],'fontweight','bold');

else

text(Vend-0.35,Iend-1,['Cell No. = ',name],'fontweight','bold');

disp('---Not show the output characteristics.---');

end

hold off;

axes(haxes(2));

axis([Vstart Vend Pstart Pend]);

set(gca,'YTick',Pstart:1:Pend,'LineWidth',2,'fontsize',18,'fontweight','bold',

'fontname', 'EucrosiaUPC');

hold on;

ylabel('Output Power (mW/cm^2)','fontsize',24,'fontweight','bold',

'fontname','EucrosiaUPC');

```
plot(Vm,Pmax,'ro');
```

set(hline2,'LineStyle','--','LineWidth',2);

xlabel('Output Voltage (V)','fontsize',24,'fontweight','bold',

'fontname','EucrosiaUPC');

hold off;

end

run solarsim;

case 3

disp('END PROGRAM');

otherwise

disp('Wrong command!');

run solarsim;

end



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติของผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาววิภากร จีวะสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ที่ตำบลทะเลซุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2544 ต่อจากนั้นได้เข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ. 2545



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย